## CaCu<sub>3</sub> Ti<sub>4</sub> O<sub>12</sub> -MgTiO<sub>3</sub> 陶瓷的介电性能 与 *I-V* 非线性特征 \*

曹 蕾 刘 鹏 制剑平 王亚娟 苏丽娜 刘 成

(陕西师范大学物理学与信息技术学院,西安 710062) (2010年1月27日收到;2010年6月7日收到修改稿)

采用固相反应法制备了一系列  $CaCu_3Ti_4O_{12}$  -  $xMgTiO_3$  (x=0, 0. 25, 0. 5, 1. 0) 复相陶瓷,研究了  $MgTiO_3$  掺杂对  $CaCu_3Ti_4O_{12}$  (CCTO) 陶瓷相结构、显微组织、介电性能和 I-V 非线性特征的影响. 研究发现:  $MgTiO_3$  掺杂不仅使 CCTO 低频介电损耗降低,压敏电压提高,而且使 I-V 非线性系数显著增大. 电学性能的改善与由  $MgTiO_3$  掺杂后导致晶粒尺寸均匀化,晶界厚度减薄且绝缘性提高有关. 其中, $CaCu_3Ti_4O_{12}$ -0.  $5MgTiO_3$  陶瓷具有良好的综合电学性能:  $\varepsilon_r=53958$ ,  $tan\delta=0$ . 06(1~kHz),压敏电压  $E_b=295~V/mm$  且非线性系数  $\alpha=66.3$ .

关键词: I-V 非线性系数, 巨介电常数, 压敏电压

PACS: 77.22. Gm, 77.22. Jp, 77.22. - d

### 1. 引言

随着微电子技术和产业的发展,电子器件日益小型化和集成化,高介电常数材料有着越来越广阔的应用前景. 近几年来,  $CaCu_3Ti_4O_{12}$  (CCTO)以其巨介电常数( $10^5$ ),良好的介电常数温度稳定性和电流-电压(I-V) 非线性特征引起研究学者的广泛关注[1-7]. 文献[4]测得 CCTO 两个晶粒之间的 I-V 非线性系数  $\alpha$  高达 912,并指出该材料有望应用于传感器或变阻器. 但是实际 CCTO 陶瓷材料所表现的非线性系数  $\alpha$  只有 3 左右[8-18],通过掺杂改性, $\alpha$  可以提高到  $7.9^{[12]}$ ,这一数据与目前广泛使用的 ZnO ( $\alpha > 50^{[19,20]}$ ) 和  $SrTiO_3$  变阻器相比,仍显太小. 因此,提高 CCTO 陶瓷非线性系数是此材料应用于变阻器领域必须解决的问题.

掺杂改性[9-18,21,22] 是改善材料性能的有效手段,目前文献报道的通过掺杂来优化 CCTO I-V 非线性行为的方法主要有在 CCTO 中掺杂  $Eu_2O_3^{[11]}$ ,  $TiO_2^{[12]}$  和  $Bi_2O_3^{[13]}$  等金属氧化物.本文研究了  $MgTiO_3$  掺杂对 CCTO 陶瓷的相结构、显微组织、介电性能和 I-V 非线性特征的影响,以期望获得具有

巨介电常数、低损耗和高 I-V 非线性系数  $\alpha$  的综合性能较好的介电材料.

### 2. 实验方法

本实验采用传统的固相反应法制备了  $CaCu_3Ti_4O_{12}$ - $xMgTiO_3(x=0,0.25,0.5,1.0)$  陶瓷样品.使用高纯的  $CaCO_3(99.99\%)$ , CuO(99.9%),  $TiO_2(99.99\%)$ 和  $MgTiO_3(99.5\%)$ 试剂为原料,按照一定的化学配比混合后进行球磨,在850 ℃下预烧6 h,再次球磨后,加入适量的黏合剂,压制成直径为11.5 mm、厚约1 mm的薄片,所有样品在1100 ℃下烧结 10 h. 烧结好的样品经磨平、被银后在500 ℃下烘30 min 以备测试.

采用日本 Rigaku 公司的 D/max-2550/PC 型 X 射线衍射仪对样品进行物相与结构分析;采用荷兰 Philips-FEI 公司 Quanta 200 型扫描电子显微镜(配有能量色散 X 射线(EDX)谱测试装置)观察样品的微观结构;采用 Agilent E 4980A 型阻抗分析仪测试样品的介电性能;采用美国 Radiant Premier II 型铁电材料分析仪测试样品的压敏电压和 I-V 非线性系数.

<sup>\*</sup> 国家自然科学基金(批准号: 50872078 和 50772065)资助的课题.

<sup>†</sup>通讯联系人. E-mail: liupeng@ snnu. edu. cn

#### 3. 实验结果与讨论

图 1 为不同组分的  $CaCu_3Ti_4O_{12}-xMgTiO_{3}$  (x=0, 0.25, 0.5, 1.0) 陶瓷的 XRD 图谱. x = 0 时为 单相立方结构的 CCTO, 当 x 增大到 0.25, 样品中仍 未检测出明显的第二相,但是(220)衍射峰向低角 度方向偏移(图1内插图),这表明,CCTO与 MgTiO, 之间发生了离子扩散. 考虑到 Cu2+ 通过 4 个键与  $O^{2}$  相连,  $Cu^{2+}$  (4 配位) 半径为 0.57 Å<sup>[23]</sup>, Ti<sup>4+</sup>(6配位)半径为0.605Å<sup>[23]</sup>,Mg<sup>2+</sup>(6配位)半 径为 0.72 Å<sup>[23]</sup>. 可见, Mg<sup>2+</sup> 半径更接近 Ti<sup>4+</sup> 半径, Mg<sup>2+</sup>易占据 Ti 位取代 Ti<sup>4+</sup>, 使 CCTO 晶胞体积增 大,导致峰位向低角度偏移. 当 MgTiO, 的掺杂量 x ≥ 0.5 时样品中出现了 MgTiO, 和 MgTi2O, 相, 衍射 峰没有再发生明显的移动. 另外, MgTiO, 在反应过 程中易转化为 MgTi<sub>2</sub>O<sub>5</sub><sup>[24]</sup>, 因此, 掺入的 MgTiO<sub>3</sub> 一 部分固溶在 CCTO 相中,另一部分以 MgTiO<sub>3</sub>/ MgTi,O,第二相的形式存在.

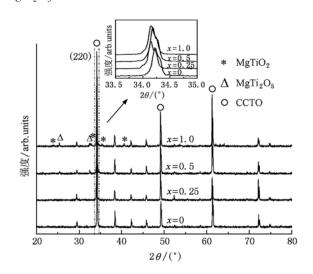


图 1 CaCu<sub>3</sub>Ti<sub>4</sub>O<sub>12</sub>-xMgTiO<sub>3</sub> (x=0, 0.25, 0.5, 1.0) 陶瓷的 XRD 图谱

图 2 给出了  $CaCu_3Ti_4O_{12}$ - $xMgTiO_3$  (x=0, 0.5) 陶瓷的 SEM 照片. 对于纯 CCTO 样品, 大晶粒 镶嵌在小晶粒基底中或很厚晶界之间(图 2(a)). 分别对大晶粒和晶界进行 EDX 谱分析, 发现大晶粒 接近 CCTO 化学计量比, 而晶界富集大量 Cu 元素, 这一结果与  $Fang^{[25]}$ 和  $Prakash^{[26]}$ 等关于纯 CCTO 组分非均匀的报道相一致.  $MgTiO_3$  掺杂后, CCTO 的显微结构发生了显著变化: 在促使小晶粒长大的同

时,抑制了大晶粒的生长,样品呈现晶粒饱满且尺 寸分布均匀、晶界清晰的微观形貌,而且平均晶粒 尺寸减小,晶界变薄(图2(b)).进一步观察图2(b) 发现,样品中存在两类不同形状的晶粒,即近似为 等轴晶粒和棒状晶粒. 等轴晶粒是 CCTO,同时含一 定量的 Mg 元素,而棒状晶粒富含大量 Mg 和 Ti 元 素,是以 MgTiO<sub>3</sub>/MgTi<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 存在的第二相(图 1). 这 种第二相的存在引起样品微观结构发生明显变化. 根据烧结传质过程的熔解-沉淀学说[27],低熔点的 CuO 可作为烧结助剂参与液相烧结,在纯 CCTO 中, 低熔点的富 Cu 物质可不断地熔化且沉淀在大晶粒 外表面上,逐渐形成较厚的晶界第二相; MgTiO。掺 杂后,较高熔点的 MgTiO,/MgTi,O, 第二相颗粒出 现,使得参与烧结的粉粒熔点得以提高,在一定程 度上阻止烧结液相的产生,从而减少富 Cu 物质在 晶界处的堆积,使晶界厚度减薄.

图 3 为室温下 20 Hz—2 MHz 频率范围内不同组分 CaCu<sub>3</sub>Ti<sub>4</sub>O<sub>12</sub>-xMgTiO<sub>3</sub>(x=0, 0.25, 0.5, 1.0)陶瓷的介电频谱. 从图中见,所有样品的介电常数在 20—10<sup>4</sup> Hz 范围内保持较高的值( $\varepsilon_r > 10000$ ).随着 MgTiO<sub>3</sub> 掺杂量的增大, $\varepsilon_r$  减小,同时低频介电损耗降  $\tan\delta$  降低.

为了解释低频介电损耗的变化规律,利用文献 [28] 给出的基于 IBLC 模型 (internal barrier layer layer capacitance model) 的介电损耗表达式: 由于 IBLC 结构可等效为包含两个电阻  $(R_{ins}, R_{sc})$  和两个电容  $(C_{ins}, C_{sc})$  的等效电路模型,其中, $R_{ins}$  和  $R_{sc}$  分别代表绝缘晶界和半导性晶粒的电阻, $C_{ins}$  和  $C_{sc}$  分别代表绝缘晶界和半导性晶粒的电容。  $R_{ins}$  和  $C_{ins}$  并联构成一个 RC 单元,代表绝缘晶粒的贡献, $R_{sc}$  和  $C_{sc}$  并联构成另一个 RC 单元,代表半导性晶界的贡献,两个 RC 单元之间相互串联. 根据这一等效电路模型,介电损耗可近似表示为 [28]

$$\tan\delta = \frac{1}{\omega R_{\rm ins}C_{\rm p}} + \omega R_{\rm sc}C_{\rm p}, \qquad (1)$$

式中 $R_{\text{ins}}$ 和 $R_{\text{sc}}$ 的值可由阻抗谱得出, $R_{\text{ins}}$ 与低频半圆的直径相对应, $R_{\text{sc}}$ 则对应Z'轴高频范围的截距.

图 4 为不同组分  $CaCu_3Ti_4O_{12}$ - $xMgTiO_3(x=0,0.25,0.5,1.0)$  陶瓷的阻抗谱. 从图中可以看出,当 x=0.25 时,与纯 CCTO 相比, $R_{ins}$ 显著增大;随着  $MgTiO_3$  掺杂量的进一步增加, $R_{ins}$ 又略有减小,但较纯 CCTO 仍有很大幅度的提高. 经拟合,四个组分样品的晶界电阻分别为  $8\times10^4$   $\Omega$ ,  $3.9\times10^6$   $\Omega$ ,  $2.2\times10^6$   $\Omega$  和  $8\times10^5$   $\Omega$ . 掺杂前后  $R_{sc}$ 变化不大,在 5—

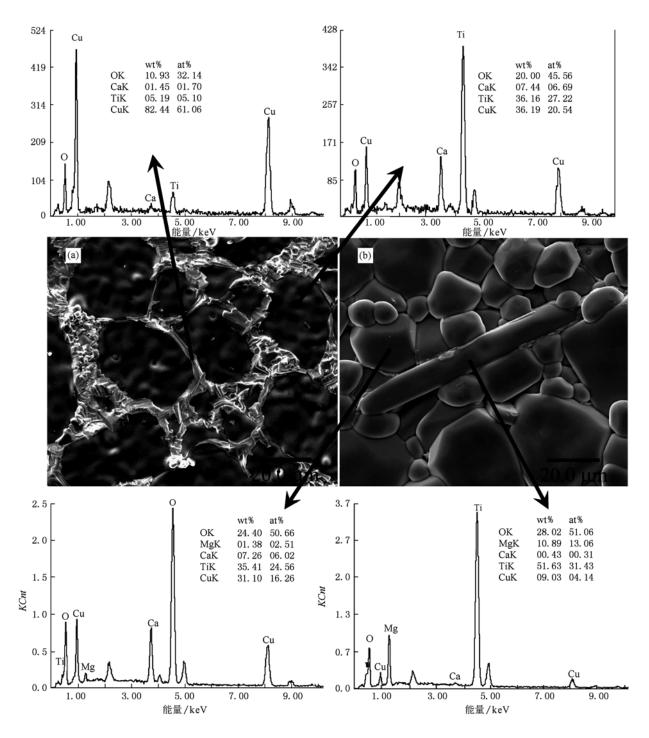


图 2  $CaCu_3Ti_4O_{12}$ -xMgTi $O_3$  陶瓷的 SEM 照片和 EDX 谱 (a)x=0; (b)x=0.5

30  $\Omega$  之间,即晶粒始终为半导性(图 4 内插图).在低频范围内,(1)式中右边第一项明显具有更高的权重, $\tan\delta \approx 1/\omega R_{\rm ins}C_{\rm p}$ ,尽管  $C_{\rm p}$  减小(图 3 (a)),但其减小的幅度小于  $R_{\rm ins}$ 增加的幅度,最终导致低频损耗降低(图 3 (b)).因此, $Mg{\rm TiO}_3$  掺杂所引起的低频介电损耗降低主要与晶界电阻  $R_{\rm ins}$  的增加有关.晶界电阻的增加是由  $Mg^{2+}$  取代  ${\rm Ti}^{4+}$  以及  $Mg{\rm TiO}_3$ /

MgTi,O, 第二相的存在共同决定的.

图 5 给出了  $CaCu_3Ti_4O_{12}$ - $xMgTiO_3$  (x=0, 0.25, 0.5, 1.0) 陶瓷的 J-E 特性. 由图可以看出,对  $MgTiO_3$  掺杂的 CCTO 样品, J-E 曲线并非文献[11] 等所示的连续平滑上升过程,而出现了类似瞬时跃变的变化趋势. 这是由于在压敏电压附近十分小的电压范围内,电流密度的变化幅度很大,导致样品

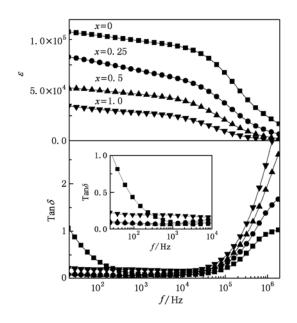


图 3  $CaCu_3Ti_4O_{12}$ - $xMgTiO_3(x=0,0.25,0.5,1.0)$ 陶瓷的介电频谱 (a)介电常数; (b)介电损耗随频率变化(内插图为介电损耗低频放大图)

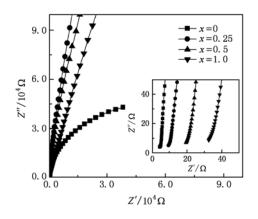


图 4  $CaCu_3Ti_4O_{12}$ - $xMgTiO_3(x=0,0.25,0.5,1.0)$ 陶瓷的阻抗谱(内插图为原点附近放大图)

对外呈现强烈的 *I-V* 非线性特征. 对于压敏电阻,非 线性关系通常由经验公式

$$I = kV^{\alpha} \tag{2}$$

所描述. 其中,k 为常量, $\alpha$  为非线性系数,可通过 J-E 曲线拟合得出.

样品的非线性系数和压敏电压( $E_b$ )测试结果如表 1 所示. 本实验中,压敏电压被定义为电流密度为 10 A/m² 时所加电场的强度<sup>[13]</sup>. 随着 MgTiO<sub>3</sub> 掺杂量的增加,压敏电压  $E_b$  从 28 V/mm 提高到 295 V/mm. 压敏电压提高是由于 MgTiO<sub>3</sub> 掺杂使 CCTO的晶粒尺寸减小(图 2(b)),从而增大绝缘晶界的

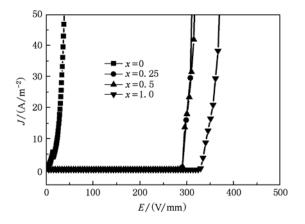


图 5 CaCu<sub>3</sub>Ti<sub>4</sub>O<sub>12</sub>-xMgTiO<sub>3</sub> (x=0,0.25,0.5,1.0) 陶瓷样品的 *J-E* 变化曲线

比重<sup>[13]</sup>,这一结果与 ZnO 基变阻器中的情况类似.由于纯 CCTO 的击穿电压只有几十伏<sup>[8-18]</sup>,压敏电压的提高有助于实现 CCTO 在较高电场下的使用. 另外,由表 1 可知,非线性系数  $\alpha$  由纯 CCTO 的 2.9 提高到了 66.6,提高 20 倍以上,与目前文献报道的 CCTO 基陶瓷 I-V 非线性系数相比<sup>[8-18]</sup>有了数量级的提高.

表 1  $CaCu_3Ti_4O_{12}$ - $xMgTiO_3(x = 0, 0.25, 0.5, 1.0)$ 陶瓷样品的非线性系数和压敏电压

组分 x	0	0. 25	0. 5	1. 0
非线性系数 α	2. 9	66. 6	66. 3	64. 9
压敏电压 $E_{\rm b}/({ m V/mm})$	28	299	295	340

MgTiO<sub>3</sub> 掺杂引起 CCTO 非线性系数的提高可以由样品微观结构的变化来解释: CCTO 具有半导性的晶粒和绝缘性的晶界,其电子能带结构等效于n型-绝缘层-n型,在晶界上具有电子吸附的受主能级,形成相对于晶界面对称且背靠背的双 Schottky势垒<sup>[4]</sup>. 当外加电压低于压敏电压时,材料的晶界势垒高,表现为高阻状态,这时电阻主要来源于晶界;当外加电压达到压敏电压时,晶界势垒逐渐被击穿,其阻值主要由晶粒电阻所决定. 所以,一个好的压敏电阻器就要求晶界势垒高,使晶界成为一个高阻的晶界层,而且晶界厚度要窄,这样易发生隧道击穿,同时晶粒电阻率要小,有利于压敏陶瓷由高阻状态迅速变为低阻状态.

根据以上分析,对于纯 CCTO,大晶粒被小晶粒或很厚的晶界所间隔(图 2(a)),当外加电压增大时,大晶粒区域先被击穿,变为低阻状态,但小晶粒

聚集区域(或很厚的晶界处)晶界绝缘相所占比重很大,仍呈高阻态,阻断大晶粒区域的漏导电流;随着外加电压进一步增大,小晶粒区域(或很厚的晶界处)也开始发生逐渐缓慢的击穿,直到电压达到压敏电压时,整个样品中的电流密度才达到 10 A/m²,因此,在这一过程中,样品电流密度的增大是一个连续缓慢的过程(图 5).而 MgTiO<sub>3</sub> 掺杂后,晶粒尺寸分布均匀且晶界很薄(图 2(b)),晶界上存在一个较薄的高阻界面层,形成较高的晶界势垒;当外加电压增大时,由于整个样品中晶粒尺寸较均匀,并没有某些区域先被击穿,直到电压达到一定量值,也就是压敏电压时,窄的晶界势垒在一瞬间发生隧道击穿,样品中电流密度迅速增大,实现了一个跃变,表现为 I-V 非线性系数大幅提高.

#### 4. 结 论

采用固相反应法制备了一系列 CaCu<sub>3</sub>Ti<sub>4</sub>O<sub>12</sub>-xMgTiO<sub>3</sub>(x = 0, 0. 25, 0. 5, 1. 0)陶瓷,研究了该材料的相结构、显微组织、介电性能和 *I-V* 非线性特性. 发现 MgTiO<sub>3</sub> 掺杂优化了 CCTO 的综合介电性能,在保持较高介电常数的同时,降低了低频介电损耗,提高了压敏电压,使 *I-V* 非线性系数从 2. 9 增大到 66. 6. 电学性能的改善与 MgTiO<sub>3</sub> 掺杂后导致晶粒尺寸均匀化和晶界厚度减薄,从而在晶界上形成一个薄的界面层,提高了晶界势垒有关. 本工作为 CCTO 材料在传感器和变阻器方面的实际应用提供了实验依据.

- [1] Homes C C, Vogt T, Shapiro S M, Wakimoto S, Ramirez A P 2001 Science 293 673
- [2] Subramanian M A, Li D, Duan N, Reisner B A, Sleight A W 2000 J. Solid State Chem. 151 323
- [3] Ramirez A P, Subramanian M A, Gardel M, Blumberg G, Li D, Vogt T, Shapiro S M 2000 Solid State Commun. 115 217
- [4] Chung S Y, Kim I D, Kang S J L 2004 Nature Mater. 3 774
- [5] Zhao Y L, Jiao Z K, Cao G H 2003 Acta Phys. Sin. **52** 1500 (in Chinese) [赵彦立、焦正宽、曹光旱 2003 物理学报 **52** 1500]
- [6] Zhou X L, Du P Y 2005 Acta Phys. Sin. **54** 354 (in Chinese) [周小莉、杜丕— 2005 物理学报 **54** 354]
- [7] Shao S F, Zheng P, Zhang J L, Niu X K, Wang C L, Zhong W L 2006 Acta Phys. Sin. 55 6661 (in Chinese) [邵守福、郑鹏、张家良、钮效鹍、王春雷、钟维烈 2006 物理学报 55 6661]
- [8] Marques V P B, Ries A, Simões A Z, Ramírez M A, Varela J A, Longo E 2007 Ceramics International 33 1187
- [9] Singh D P, Mohapatra Y N, Agrawal D C Mater. 2009 Mater. Sci. Eng. B 157 58
- [10] Fang L, Shen M R, Li Z Y 2006 J. Appl. Phys. 100 104101
- [11] Li T, Chen Z P, Chang F G, Hao J H, Zhang J C 2009 J. Alloy Compd. 484 718
- [12] Lin Y H, Cai J N, Li M, Nan C W 2006 Appl. Phys. Lett. 88 172902
- [13] Luo F C, He J L, Hu J, Lin Y H 2009 J. Appl. Phys. 105 076104
- [14] Cai J N, Lin Y H, Cheng B, Nan C W, He J L, Wu Y J, Chen X M 2007 Appl. Phys. Lett. 91 252905

- [15] Xue H, Guan X F, Yu R, Xiong Z X 2009 J. Alloy Compd. 482 L14
- [16] Chung S Y, Lee S I, Choi J H, Chio S Y 2006 Appl. Phys. Lett. 89 191907
- [17] Chung S Y, Choi S Y, Yamamoto T, Ikuhara Y, Kang S J L 2006 Appl. Phys. Lett. 88 091917
- [18] Leret P, Fernandez J F, Frutos J D, Hevia D F 2007 J. Eur. Ceram. Soc. 27 3901
- [19] Clarke D R 1999 J. Am. Ceram. Soc. 82 485
- [20] Ji S D, Fan F K 1997 *J. Ceram.* 18 52 (in Chinese) [纪士东、 范福康 1997 陶瓷学报 **18** 52]
- [21] Liu P, He Y, Li J, Zhu G Q, Bian X B 2007 Acta Phys. Sin. **56** 5489 (in Chinese) [刘 鹏、贺 颖、李 俊、朱刚强、边小兵 2007 物理学报 **56** 5489]
- [22] Mu C H, Liu P, He Y, Zhang D, Meng L, Bian X B 2008 Acta
  Phys. Sin. 57 2432 (in Chinese) [慕春红、刘 鹏、贺 颖、
  张 丹、孟 玲、边小兵 2008 物理学报 57 2432]
- [23] Shannon R D 1976 Acta Cryst. A 32 751
- [24] Wang J F, Luo J H 2007 B. Chinese Ceram. Soc. **26** 514 (in Chinese) [王加芳、罗驹华 2007 硅酸盐通报 **26** 514]
- [25] Fang T T, Mei L T 2007 J. Am. Ceram. Soc. 90 638
- [26] Prakash B S, Varma K B R 2007 J. Phys. Chem. Solids 68 490
- [27] New Inorganic Material Teaching and Research Group of Shanghai Science and Technology University 1977 The Electronic Ceramics Processing Basics (Shanghai: Shanghai People Press) p111 (in Chinese) [上海科技大学新型无机材料教研组 1977 电子陶瓷工艺基础 (上海:上海人民出版社) 第 111 页]
- $[\,28\,]$  Yan Y Y , Jin L , Feng L X , Cao G H 2006  $\mathit{Sci.}\,$  Eng. B 130 146

# Dielectric properties and nonlinear current-voltage behavior of MgTiO<sub>3</sub> -doped CaCu<sub>3</sub> Ti<sub>4</sub> O<sub>12</sub> ceramics \*

Cao Lei Liu Peng<sup>†</sup> Zhou Jian-Ping Wang Ya-Juan Su Li-Na Liu Cheng (College of Physics and Information Technology, Shaanxi Normal University, Xi'an 710062, China) (Received 27 January 2010; revised manuscript received 7 June 2010)

#### Abstract

The  $CaCu_3Ti_4O_{12}$ - $xMgTiO_3$  (x=0, 0.25, 0.5, 1.0) ceramics have been prepared by a solid-state reaction method. The effects of  $MgTiO_3$  doping on the phase structure, microstructure and dielectric properties of  $CaCu_3Ti_4O_{12}$  ceramics have been investigated. The results indicate that  $MgTiO_3$  doping not only reduced the dielectric loss of low frequency range and raised the breakdown voltage but also significantly improved the I-V nonlinearity coefficient. The optimized properties of  $MgTiO_3$  doped  $CaCu_3Ti_4O_{12}$  can be well explained by the uniformity of the grains, the reduction of the average grain boundary thinkness and the enhancement of the grain boundary resistance. Among the  $CaCu_3Ti_4O_{12}$ - $MgTiO_3$  specimens in this work, the  $CaCu_3Ti_4O_{12}$ - $O.5MgTiO_3$  specimen has achieved the best comprehensive properties, which include a dielectric constant ( $\varepsilon_r$ ) of 53958, dielectric loss ( $tan\delta$ ) of 0.06 at 1 kHz, breakdown voltage ( $E_b$ ) of 295 V/mm and a large nonlinearity coefficient of 66.3.

**Keywords:** current-voltage nonlinear coefficient, giant dielectric constant, breakdown voltage **PACS:** 77.22. Gm, 77.22. Jp, 77.22.-d

<sup>\*</sup> Projects supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 50872078 and 50772065).

<sup>†</sup> Corresponding author. E-mail: liupeng@ snnu. edu. cn